PAT-NO:

JP409005982A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09005982 A

TITLE:

METHOD FOR PEELING MASK PROTECTIVE DEVICE

PUBN-DATE:

January 10, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SATOMI, REI

KONDO, MASAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUI PETROCHEM IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP07174117

APPL-DATE:

June 17, 1995

INT-CL (IPC): G03F001/14, B65H041/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to rapidly and cleanly peel a pellicle from a quartz substrate in any place by executing the stripping of a stuck mask protective device from the substrate after immersing the device into hot water.

CONSTITUTION: The pellicle adhered to the quartz substrate 7 by an adhesive of a hot melt type is stripped from the substrate after the pellicle is immersed into the hot water at the time of stripping the pellicle. Namely, a pin 4 at the front end of a lever 3 is inserted into jig holes 2 bored at the four circumferences of, for example, a pellicle frame 1 and the top end of the

lever 3 is depressed by setting the depressing speed of an instron 6 in the state of applying a block 5 afterward, by which the <u>pellicle</u> is peeled from the quartz substrate 7. The immersion temp. into the hot water is ≥40°C, more preferably 50°C, and more particularly preferably 60°C and while there is no particular upper limit, the handling under atm. pressure is generally frequent and, therefore, the immersion temp. is ≤100°C or below the destruction temp. of a <u>reticle</u>.

COPYRIGHT: (C)1997JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-5982

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所
G03F	1/14			G 0 3 F 1/14	J
B65H	41/00		9245-3F	B65H 41/00	В

寒杏静水 未静水 静水項の数3 FD (全 6 首)

		一個工門水	不用不 用不为(V)数3 FD (主 U 具)
(21)出顧番号	特膜平 7-174117	(71)出願人	000005887 三井石袖化学工業株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)6月17日		東京都千代田区麓が関三丁目2番5号
		(72)発明者	里見 琦 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井石油化学工業株式会社内
,		(72) 発明者	近藤 正浩 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井石油化学工業株式会社内
		(74)代理人	<u> </u>
	•		

(54) 【発明の名称】 マスク保護装置の剥離方法

(57)【要約】

【目 的】 マスクに塵埃等が付着するのを防止する目 的で石英基板上に接着されるペリクルをきれいに、かつ 短時間で基板より剥離することができ、しかも剥離が場 所を問わずどこでも行えるようにする。

【構 成】 ペリクルを石英基板ごと40℃以上の温水に浸してから剥離する。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マスクやレチクルに塵埃等が付着するの を防止する目的でマスクを覆うようにして基板上にホッ トメルトタイプの接着剤を用いて貼着されるマスク保護 装置の基板よりの引剥がしを温水に浸してから行うこと を特徴とする剥離方法。

【請求項2】 温水は40℃以上である請求項1記載の 剥離方法。

【請求項3】 温水には界面活性剤が添加される請求項 1又は2記載の剥離方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIなど集積回路の 製造工程において、マスクやレチクル(以下「マスク」 という)に塵埃等が付着するのを防止する目的でマスク を覆うようにして基板上に貼着されるマスク保護装置 (以下「ペリクル」という)の剥離方法に関する。

[0002]

【従来技術】集積回路の製造工程におけるフォトリソグ ラフィ工程では、マスク上に塵埃等が付着すると、これ 20 が半導体ウエハに投影され、不良製品となりがちであ る。この問題を解消し、マスク上に異物が付着するのを 防止するため、マスクパターンを囲う大きさの枠の一側 面に透明な薄膜を張設し、他傾端面を石英基板上に通常 ホットメルトタイプの接着剤を用いることにより接着し てマスクを薄膜により一定の間隔を存して覆うようにし たペリクルが供されるようになった。

【0003】こうしたペリクルも長期間使用すると、膜 に異物が付着し、製品不良の問題を発生させる。そのた め定期的に、或いは異物の付着に応じて適宜ペリクルの 30 に要する力を測定した。 交換が行われるが、ペリクル交換のため、ペリクルを基 板より引剥がす際には、石英基板が傷付かず再使用し易 いようにきれいに剥がす必要がある。そこで従来は、ス ポイド等を用いて有機溶剤を枠周縁に滴下して引剥がす か、或いは基板ごと室温の水に24時間浸して引剥がし ていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】有機溶剤の使用は、使 用場所が限られ、場所によっては使用できないことがあ る。また水に浸漬して剥離するのは時間がから難点が 40 ある。本発明は、ペリクルの石英基板からの剥離が短時 間で、きれいに、しかもどのような場所でも行えるよう にすることを目的とする。

[0005]

【課題の解決手段】本発明者らは、ペリクルの簡易な引 剥方法について、種々実験を行った結果、温水に浸す と、きれいに、しかも短時間でペリクルが剥離できるこ とを見出した。本発明はこの知見に基づいてなされたも ので、石英基板にホットメルトタイプの接着剤により接 着したペリクルを引剥がす際、温水に浸してから引剥が 50 の石英基板の剥離面を示す。図5及び図6の顕微鏡写真

すことを特徴とする。ホットメルトタイプの接着剤とし ては、例えばエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 系、ポリアミド系、ポリオレフィン系、熱可塑ゴム系、 エポキシ系、ポリエステル系、或いはシリコン系接着剤

等を挙げることができ、具体的な例としては、アサヒタ ック株式会社製A131、ダイアボンド工業株式会社製 のメルトロン(商品名)シリーズ等が挙げられる。

【0006】温水への浸漬温度は40℃以上、好ましく は50℃以上、特に好ましくは60℃以上であり、上限 10 は特にないが、一般的には常圧での取扱が多いため、1 00℃以下又はレチクルの破壊温度未満である。温水へ の浸漬時間は3分以上、好ましくは5分以上、特に好ま しくは10分以上であり、上限は特にないが、一般に1 時間未満とするのが工業的に好ましく、更に25分を越 えてもその効果はほど一定となるため、通常は3分~2 5分の範囲内で最も作業しやすい時間が設定される。 温 水はそのま、使用してもよいが、好ましくは界面活性剤 が添加される。これにより剥離力が低下し、浸漬時間を 短くすることができる。

[0007]

【実施例】

実施例1

長さ120㎜、幅98㎜、厚み6.3㎜のペリクル (三 井石油化学工業株式会社製、N52SP)の枠端面にス チレン・エチレンブチレン・スチレンのホットメルトタ イプの接着剤 (アサヒタック株式会社製A131)を 5mmの厚さに塗ったのち、石英基板上に30kgの 力で3分間押付けて貼着した。その後3日間放置したの ち、40℃の温水に3~10分間浸し、ペリクルの剥離

・【0008】測定は、図1に示すように、ペリクル枠1 の四囲に穿けられた治具孔2にレバー3先端のピン4を 差込み、後からブロック5を当てがった状態でインスト ロン6の押下げ速度を20mm/min に設定してレバー上 端を押下げ、ペリクルを石英基板7より剥離したときの 荷重をINTESCO社製の測定装置(2005Sモデ ル)を用いて測定した。その結果を表1及び図2に示 す。

【0009】実施例2

温水の温度を60℃とする以外は実施例1と同様にして ペリクルが剥離したときの荷重を測定した。その結果を 表1及び図2に示す。図3及び図4はペリクルを剥離し たのちの石英基板の剥離面を示す。図3及び図4の顕微 鏡写真に示すように、基板上に残る接着剤量は殆どなか った。

【0010】比較例1

実施例1のペリクルを温水に浸すことなく、実施例1と 同様の方法によって剥離した。 そのときの剥離力は19 8gであった。 図5及び図6はペリクルを剥離したのち 3

に示すように、基板上には接着剤がかなり残存した。 比較例2

温水を室温水(22~23℃)とし、浸漬時間を10分及び30分とする以外は、実施例1と全く同様にして実験を行ったところ、剥離力は各々197g、198gで、比較例1とほゞ同じであり、目視上で基板上に接着剤の残存が多数確認された。

[0011]

【表1】

				剝離力 (g)
実	准	Ħ	1 (40%)	•
			3 min	146
			5 min	127
			1 Omin	9 9
実	集	Ħ	2 (60T)	
			3 min	9 3
			5ein	5 7
			1 Omin	4 1
比	較	例	1	198
比	較	例	2 (22 ~33°C)	
			1 0=ia	197
			3 Omin	198

[0012]

【発明の効果】本発明は以上のように、ペリクルを石英 基板と共に温水に浸すことによってきれいに、しかも短 時間で引剥がすことができ、温水であるため、場所を問 わずどこでも使用することができる。また温水に昇面活 性剤を添加することにより、ペリクルの引剥がしがより 容易に、しかも温水への浸漬をより短くして行うことが できる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】 ペリクルを石英基板より引剥がすときの状態を示す図。

【図2】 各温度におけるペリクルの剥離力を示す図。

【図3】 実施例2の石英基板の剥離面を示す顕微鏡写真(×39)。

【図4】 同拡大写真(×390)。

【図5】 比較例の石英基板の剥離面を示す顕微鏡写真 (×39)。

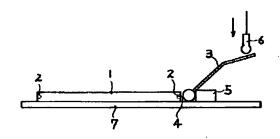
【図6】 同拡大写真(×390)。

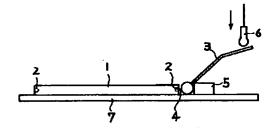
【符号の説明】

20 1・・ペリクル枠 2・・治具孔 3・・レバ

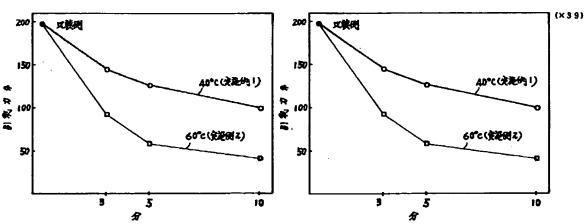
6・・インストロン 7・・石英基板

【図1】









【図3】

器道代用写真

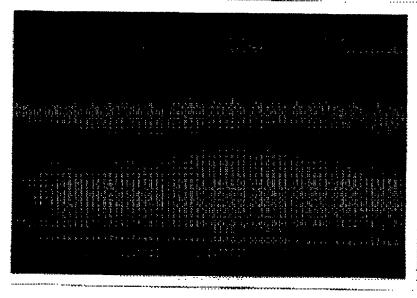
【図4】

国面代用字具

(×390)

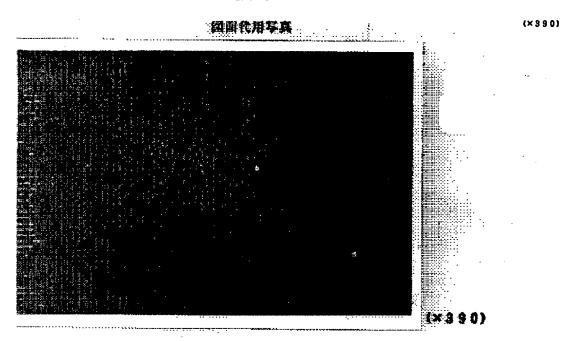
【図5】

回面代用写真



X39

【図6】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.